

УДК 537.531:535.3

# СПЕКТРОМЕТРЫ НА ОСНОВЕ МНОГОСЛОЙНЫХ РЕНТГЕНОВСКИХ ЗЕРКАЛ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ

© 1999 г. Э. П. Кругляков, А. Д. Николенко, Е. П. Семенов, Е. Д. Чхало, Н. И. Чхало

ГНЦ Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Россия, Новосибирск

Поступила в редакцию 03.04.1998 г.

Описываются разработанные в последнее время в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН спектрометры для экспериментов на термоядерных установках RFX (г. Падуя, Италия) и GAMMA-10 (г. Цукуба, Япония). Приводятся данные по спектральным характеристикам ряда многослойных рентгеновских зеркал.

## ВВЕДЕНИЕ

Многослойные рентгеновские зеркала (MPЗ) все шире применяются в современных спектрометрах мягкого рентгеновского излучения для диагностики высокотемпературной плазмы [1–3]. Это объясняется существенно более высокими интегральными и пиковыми коэффициентами отражения MPЗ по сравнению с традиционными диспергирующими элементами. Нормальные рабочие углы зеркал в диапазоне 2–50 нм [4–6] позволяют создавать стигматические изображающие схемы с высоким пространственным разрешением. Благодаря простоте, компактности и относительной дешевизне этого типа приборов, на их основе создаются многоканальные томографические системы [7]. Спектральное разрешение MPЗ  $\lambda/\delta\lambda \approx 100$  вполне достаточно для разрешения  $K$ -линий легких ионов примесей различной кратности ионизации.

В настоящей работе описываются разработанные в последнее время в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН спектрометры для работы на термоядерных установках RFX (г. Падуя, Италия) и GAMMA-10 (г. Цукуба, Япония). Приводятся данные по спектральным характеристикам ряда многослойных рентгеновских зеркал.

## СХЕМА СПЕКТРОМЕТРА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Для экспериментов на пинчё с обращенным полем RFX (г. Падуя, Италия) был разработан и изготовлен двухканальный перестраиваемый спектрометр. Основная задача этого спектрометра – мониторинг примесей кислорода по рентгеновскому излучению  $K_\alpha$ -линий ионов  $O^{6+}$  и  $O^{7+}$ , длины волн  $\lambda = 2.16$  и  $1.9$  нм соответственно. Геометрия этого прибора и зеркала позволяют проводить измерения в диапазоне  $\lambda = 1.8$ – $4.3$  нм.

Спектрометр состоит из корпуса и двух идентичных каналов, собранных на отдельных фланцах. Схема одного канала приведена на рис. 1. Он состоит из антирассеивающего диафрагменного коллиматора (на рисунке не показан), отрезающего фильтра, коллиматора Соллера и  $\theta$ – $2\theta$ -гониометра. На  $\theta$ -плече гониометра установлено многослойное зеркало ( $65 \times 30 \times 5$  мм), на  $2\theta$ -плече – детектор. На обратной стороне фланца смонтировано механическое устройство, позволяющее, без вскрытия прибора на “атмосферу”, в режиме  $\theta$ – $2\theta$  изменять угол падения излучения на зеркало. Угловое положение зеркала индицируется на лимбе в диапазоне  $0$ – $45^\circ$  с ценой деления  $3'$ .

Канал на  $\lambda = 2.16$  нм содержит Cr/C-зеркало с числом периодов 35 и периодом 3.2 нм. Коэффициент отражения зеркала на этой длине волн составил 17% при спектральном разрешении 33. В качестве фильтра используется майларовая пленка толщиной 1 мкм с нанесенным на нее слоем 0.12 мкм Cr. Пропускание фильтра составляет 14.1%. Второй канал, предназначенный для регистрации излучения с  $\lambda = 1.9$  нм, укомплектован Ni/C-зеркалом с числом периодов 55 и величиной периода 3.4 нм. Коэффициент отражения на  $\lambda =$

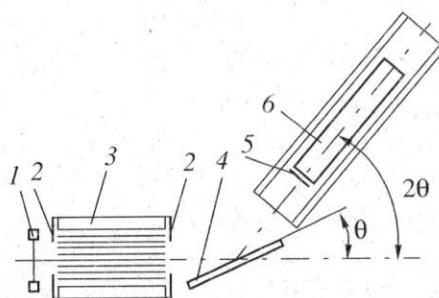


Рис. 1. Рентгенооптическая схема канала: 1 – отрезающий фильтр, 2 – входная диафрагма, 3 – коллиматор Соллера, 4 – многослойное рентгеновское зеркало, 5 – сцинтиллятор, 6 – фотоэлектронный умножитель.

= 1.9 нм составил 7% при спектральном разрешении 54. Отрезающий фильтр представляет собой майларовую пленку толщиной 1 мкм с нанесенным на нее слоем Fe толщиной 0.15 мкм. Пропускание фильтра составляет 21.3%. В качестве детекторов используются фотоумножители ФЭУ-130 с NE110-сцинтиллятором, на поверхность которого нанесен светозащитный слой Al толщиной 0.1 мкм. Двухслойный магнитный экран ФЭУ обеспечивает работу спектрометра в полях 300 Гс с любой ориентацией вектора магнитной индукции.

С 1995 года спектрометр работает на установке RFX для наблюдения временной эволюции водородо- и гелийподобных состояний углерода и кислорода. Подробно результаты первых экспериментов, полученных с использованием этого спектрометра, изложены в работах [8, 9].

Двухканальный перестраиваемый спектрометр для экспериментов на GAMMA-10 рассчитан на работу с непрерывным и линейчатым спектром в диапазонах  $\lambda = 10\text{--}25$  нм (первый канал) и  $\lambda = 3.6\text{--}10$  нм (второй канал). Конструктивно этот спектрометр выполнен аналогично предыдущему. Диапазон рабочих углов  $20\text{--}75^\circ$ . Для первого канала в качестве зеркала впервые применяется многослойная Y/Si-структура (период 14 нм, число периодов 40), имеющая в 2–3 раза большее спектральное разрешение, чем традиционные Mo/Si-зеркала при сопоставимых коэффициентах отражения. Спектральные характеристики этого зеркала приведены ниже. Фильтр представляет собой пленку Be толщиной 0.15 мкм, защищенную с двух сторон углеродом толщиной по 20 нм и приклеенную на никелевую сетку с размером ячейки 0.5 мм. Пропускание фильтра на  $\lambda = 25$  нм составляет 35%. Для защиты ФЭУ от видимого света сцинтиллятор запылен слоем Be толщиной 0.15 мкм.

**Таблица 1.** Данные калибровки спектрометра для GAMMA-10

Энергия фотонов, эВ	C	Энергия фотонов, эВ	C
50	$3.3 \times 10^{-17}$	150	$7.0 \times 10^{-17}$
60	$5.2 \times 10^{-17}$	180	$8.8 \times 10^{-17}$
70	$7.8 \times 10^{-17}$	210	$1.4 \times 10^{-16}$
80	$1.7 \times 10^{-16}$	240	$1.9 \times 10^{-16}$
90	$2.5 \times 10^{-16}$	270	$2.7 \times 10^{-16}$
100	$1.0 \times 10^{-16}$	280	$3.7 \times 10^{-16}$
110	$6.6 \times 10^{-17}$	300	$8.0 \times 10^{-18}$
120	$5.9 \times 10^{-17}$	320	$8.0 \times 10^{-18}$
130	$7.2 \times 10^{-17}$	330	$8.3 \times 10^{-18}$
		340	$8.5 \times 10^{-18}$

На втором канале установлено W/C-зеркало с периодом 5.5 нм и числом периодов 60. Канал укомплектован титановыми (толщина 0.15 мкм) и алмазоподобными углеродными пленками (толщина 0.15 мкм), приклеенными на никелевые сетки с размером ячейки 0.5 мм. Для защиты ФЭУ от видимого и вакуумного ультрафиолетового излучения сцинтиллятор запылен Ti с толщиной 0.13 мкм.

### КАЛИБРОВКА СПЕКТРОМЕТРА

При регистрации линейчатого излучения ток на выходе детектора  $I_d$  может быть представлен в виде:

$$I_d = FS\sigma\varepsilon T(\Omega/\Delta\theta) \int_{\theta_m - \Delta\theta/2}^{\theta_m + \Delta\theta/2} R(\theta)K(\theta - \theta_m)d\theta,$$

где  $I_d$  измеряется в амперах;  $F$  – поток излучения из источника, измеряемый в фотонах/ $\text{см}^2 \cdot \text{стэр} \cdot \text{с}$ ;  $S$ ,  $\text{см}^2$  – площадь источника, с которой излучение попадает на диафрагму прибора;  $\sigma$  – чувствительность детектора, Кл/фотон;  $\varepsilon$  – эффективность регистрации детектора;  $T$  – пропускание фильтра;  $\Omega$  – телесный угол диафрагмы спектрометра;  $\Delta\theta$  – угловая расходимость падающего излучения;  $\theta$  – брэгговский угол;  $R(\theta)$  – угловая зависимость коэффициента отражения рентгеновского зеркала;  $K(\theta - \theta_m)$  – пропускание коллиматора Соллера. Таким образом, для определения спектральной мощности источника необходимы данные:  $\sigma$ ,  $\varepsilon$ ,  $T$ ,  $R(\theta)$ ,  $K(\theta - \theta_m)$ . Выражая телесный угол и угловую расходимость через размер диафрагмы и расстояние от источника до диафрагмы спектрометра  $L$  [см], для протяженного источника формулу можно переписать следующим образом:

$$I_d = CFSZ^{-1},$$

где  $C$  – функция от энергии фотонов, содержащая калибровочные данные спектрометра.

Отражательные характеристики зеркал и пропускание фильтров в зависимости от длины волн измерялись на стенде, описанном в [10]. Независимо по длинам волн весь прибор калибровался на лазерно-плазменном источнике [11] и с помощью рентгеновской трубки на отдельных спектральных линиях. Пропускание коллиматора Соллера рассчитывалось по методике, описанной в [12]. Чувствительность детекторов определялась с использованием синхротронного излучения на ВЭПП-2М [13]. Кроме того спектрометр для GAMMA-10 был непосредственно установлен на канал СИ и была произведена калибровка чувствительности в рабочем диапазоне длин волн. Данные обоих методов хорошо совпали.

В таблице 1 приведены данные калибровки спектрометра для GAMMA-10 в диапазоне энер-

гий фотонов 50–340 эВ. Из таблицы видно, что при энергии фотонов 90 эВ, расстоянии между спектрометром и плазмой 1 м, площади источника  $1 \text{ см}^2$  минимальный регистрируемый поток излучения из источника, определяемый шумами ФЭУ ( $0.1 \text{ нA}$ ), составляет  $4 \cdot 10^5 \text{ фотонов}/\text{см}^2 \text{ стер. с}$ .

## МНОГОСЛОЙНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ ЗЕРКАЛА

Для изготовления многослойных рентгеновских зеркал применялись методы импульсного лазерного испарения и магнетронного распыления. Синтез зеркал лазерным методом произошел на установке, описанной в [14]. Зеркала наносились на плоские и сферические суперполированные подложки [15] из плавленного кварца.

Сводные данные по спектральным характеристикам ряда многослойных структур приведены в табл. 2. Как видно из таблицы в области спектра от 0.7 до 2 нм структуры W/Si имеют более высокие коэффициенты отражения и спектральное разрешение по сравнению с углеродсодержащими зеркалами. Исключение составляют области  $L$ -краев поглощения металлов, входящих в структуру зеркала в качестве сильно поглощающего материала: Cr, Fe, Co и Ni. На  $L$ -линиях этих элементов наблюдается аномально высокое отражение.

Зависимость отражательных характеристик W/Si-зеркал в диапазоне  $\lambda = 0.154$ – $1.76$  нм от величины периода многослойной структуры можно проследить на рис. 2. Как и следовало ожидать, с уменьшением периода наблюдается заметное уменьшение коэффициентов отражения. Обращает на себя внимание следующий факт: зеркало с периодом 1.47 нм имеет коэффициент отражения 17% на  $\lambda = 0.154$  нм, что составляет 22% от идеального, в то время, как коэффициент отражения на  $\lambda = 0.834$  составляет только 9.6% от идеального. Это можно объяснить тем, что в отражении эффективно участвует только 105 периодов. Для достижения более высокого коэффициента отражения необходимо улучшить периодичность структуры. Влияние подложки на коэффициенты отражения можно проследить на примере зеркал с периодами 3.0 и 2.6 нм. Первое зеркало наносилось на подложку типа "бороское стекло" (float glass), второе на кварцевую подложку, полированную по технологии, описанной в [15]. Как видно из рисунка, несмотря на меньший период отражение от зеркала, нанесенного на кварцевую подложку, заметно выше.

Для области ультрамягкого рентгеновского диапазона (10–25 нм) впервые была применена Y/Si-структура, которая, в отличие от традиционно используемых в этом диапазоне пар Mo/Si и Mo/B<sub>4</sub>C, теоретически имеет в 2–2.5 раза большее

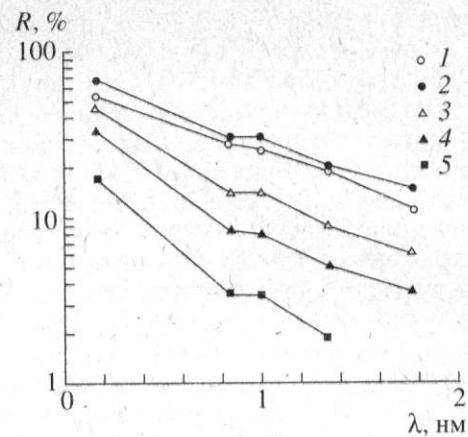


Рис. 2. Зависимость отражательных характеристик W/Si-зеркал в диапазоне 0.154–1.76 нм от величины периода многослойной структуры: 1 – 3.0 нм, 2 – 2.6 нм, 3 – 2.0 нм, 4 – 1.8 нм, 5 – 1.47 нм.

спектральное разрешение при сопоставимых пиковых коэффициентах отражения. Зеркала наносились методом магнетронного напыления при

Таблица 2. Сводные данные по характеристикам изготовленных многослойных рентгеновских зеркал на область 0.8–25.2 нм

$\lambda, \text{ нм}$	Материалы	$\theta, {}^\circ$	$R, \%$	$\lambda/\Delta\lambda$	Метод напыления
0.834	W/Si	9.0	33.7	71	МР
0.834	Fe/C	6.1	29	35	ИЛИ
0.989	W/Si	10.7	32.6	74.5	МР
1.33	W/Si	14.5	21.0	73.2	МР
1.46	Ni/C	18	11	37	ИЛИ
1.60	Co/C	16	16	34	ИЛИ
1.76	Fe/C	14	27	30	ИЛИ
1.76	W/Si	19.3	15.7	71.2	МР
2.16	Ni/C	7.3	19	51	ИЛИ
2.16	Cr/C	19	17	31	ИЛИ
2.43	V/C	19	13	32	ИЛИ
4.47	Ni/C	19	33	15	ИЛИ
4.47	Fe/C	45	10	65	ИЛИ
6.44	Co/C	55	9	40	ИЛИ
11.4	Ti/Be	18	42	7	ИЛИ
11.4	Y/Si	24	8.3	15	МР
13.5	Ti/Be	23	32	8	ИЛИ
13.5	Y/Si	30.1	33.7	20	МР
17.1	Y/Si	41	14.5	21.5	МР
25.2	Y/Si	75	13	22.0	МР

Обозначения: МР – магнетронное распыление, ИЛИ – импульсное лазерное испарение.

мощности в разряде  $\sim 100$  Вт и при давлении  $3 \cdot 10^{-3}$  Торр. Спектральные характеристики изучались на  $\lambda = 0.154, 11.4, 13.6, 17.1$  и  $25.2$  нм. В табл. 2 приведены данные для зеркала, которое применялось в спектрометре. Сопоставление экспериментальных и расчетных данных показало, что спектральное разрешение зеркал несколько превышает расчетное, в то время как коэффициенты отражения в  $1.3\text{--}1.5$  раза ниже теоретических в области ниже  $L$ -края Si и практически совпадают с расчетными на длинах волн  $0.154$  и  $11.4$  нм. Одним из возможных объяснений этих результатов может быть предположение о наличии значительного окисления иттриевого слоя, которое с одной стороны приводит к дополнительному поглощению в ультрамягком диапазоне, и с другой — уменьшает плотность пленки иттрия, тем самым снижая скачок оптической плотности на границе Y-Si. Кроме того содержание иттрия в мишени не превышало  $93\%$  и примеси (тантал, железо, кальций) могли приводить к дополнительному поглощению. В дальнейшем предполагается детальное изучение этих эффектов с использованием EXAFS-спектроскопии по методике, которая была успешно применена для изучения внутреннего строения и процессов при отжиге в многослойных Co/C- и Ni/C-структурах [16, 17].

В заключение авторы выражают глубокую признательность доктору М. Валисе за ценные обсуждения при разработке спектрометра, В.А. Капитонову за помощь при решении ряда технических проблем и М.В. Сомову за сборку большинства механических узлов. Работа выполнена при частичной поддержке Международного научно-технического центра по проекту 438.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Blake R.L., Hockadat R.C., Crosso J.S. et al. // Proc. SPIE. 1986. V. 688. P. 146.
2. Ахсалян А.Д., Белик В.П., Бобашёв С.В. и др. // Тез. 5 Всесоюзн. совещания по диагностике высокотемпературной плазмы. Минск: БГУ, 1990. С. 163.
3. May M.J., Finkenthal M., Regan S.P. et al. // Rev. Sci. Instrum. 1995. V. 66. P. 561.
4. Salashchenko N.N., Gaponov S.V., Akhsakhalyan A.D. et al. // Proc. SPIE. 1991. V. 1800. P. 195.
5. Christensen F.E., Shou-hua Zhu, Hornstrup A. et al. // J. X-ray Science and Technology. 1991. V. 3. P. 1.
6. Salashchenko N.N., Platonov Yu.Ya., Zuev S.Yu. // Nucl. Instrum. and Meth. in Phys. Res. A. 1995. V. 359. P. 114.
7. Stutman D., Hwang Y.S., Menard J. et al. // APS Meeting, Monterey, 1996. P. 112.
8. Carraro L., Chkhalo N., Kruglyakov E. et al. // Rev. Sci. Instrum. 1997. V. 68. P. 2279.
9. Carzotti L., Martini S. et al. // Proc. 23 EPS Conference on Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion, Kiev, Украина, 1996. Kiev: The European Physical Society, 1996. V. 2. P. 637.
10. Chkhalo N.I., Fedorchenko M.V., Kovalenko N.V. et al. // Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. A. 1995. V. 359. P. 121.
11. Горбовский А.И., Кругляков Э.П., Федорченко М.В., Чхало Н.И. // Физика плазмы. 1994. Т. 20. № 1. С. 98.
12. Chkhalo N.I., Kruglyakov E.P., Semenov E.P. // Proc. 9 Meeting on High Temperature Plasma Diagnostics, S. Peterburg, Russia, 1997. J. Plasma Devices and Operation, 1998 (in press).
13. Chkhalo N.I., Evstigneev A.V., Holopov M.A. et al. // Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. A. 1995. V. 359. P. 440.
14. Анашин В.В., Валыка И.Е., Гаврилов Н.Г. и др. // ПТЭ. 1995. Т. 4. С. 177.
15. Chkhalo N.I., Fedorchenko M.V., Kruglyakov E.P. et al. // Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. A. 1995. V. 359. P. 155.
16. Chernov V.A., Chkhalo N.I., Fedorchenko M.V. et al. // J. X-Ray Science and Technology. 1995. V. 5. P. 65.
17. Chernov V.A., Chkhalo N.O., Fedorchenko M.V. et al. // J. of X-Ray Science and Technology. 1995. V. 5. P. 389.

#### Multilayer X-ray Mirror Spectrometers for High Temperature Plasma Diagnostics

**E. P. Kruhgliakov, A. D. Nikolayenko, E. P. Semyonov, E. D. Chkhalo, N. I. Chkhalo**

Spectrometers based on multilayer X-ray mirrors produced at the Budker Institute of Nuclear Physics for experiments on thermonuclear facilities as RFX (Padove, Italy) and GAMMA-10 (Tsukuba, Japan) are described. Experimental data on spectral characteristics of multilayer X-ray mirrors are presented.